# 규 격 / 사 양 서

<table>
<tr><td>1. 개요</td><td>
<table>
<tr><td>품명</td><td colspan="3">광학시스템</td></tr>
<tr><td>수량</td><td>1</td><td>제조사</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2. 용도 및 특징</td><td><광 지연 라인><br>1. 펌프-프로브 분광 실험에서 광 경로 길이를 변화시켜 두 광펄스 사이의 지연 시간을 조절하는 장치<br>2. 4 나노초 범위의 광학적 지연 시간<br>3. 컴퓨터로 이동 위치를 설정, 반복 스캔 수행 및 정밀 위치 제어 가능<br>4. 광학 테이블에 설치하여 기존 펌프–프로브 광학계와 연동</td></tr>
<tr><td>3. 기기구성</td><td><광 지연 라인><br>1. 직접 구동 선형 스테이지: 1식<br>2. 컨트롤러: 1식<br>3. 초고속 레이저용 은 코팅 거울: 2식<br>4. 은 코팅 나이프엣지 직각 프리즘 거울: 1식<br>5. 광학 소자용 거울 홀더: 2식<br>6. 링 구동 아이리스: 2식<br>7. 광학 마운트: 2식</td></tr>
<tr><td>4. 규격 및 사양</td><td><광 지연 라인><br>1. 광학적 지연 성능<br>최대 광학적 지연 범위: 4 ns<br>최소 설정 가능한 지연 증분: 1 fs 이하<br>광 경로를 왕복시키는 반사 광학계 구성 가능<br>2. 이동 및 위치 제어<br>이동 거리: 600 mm<br>최대 이동 속도: 400 mm/s<br>광축 방향 절대 위치 정확도: ±12 μm 이내<br>위치 피드백을 이용한 폐루프 제어 가능<br>컴퓨터를 통한 위치 설정 및 연속 이동 제어 가능<br>3. 광학 부품<br>광 경로 조절을 위한 저분산 은 코팅 거울 및 재귀반사 광학계 포함<br>광축 정렬을 위한 탈착식 아이리스 포함</td></tr>
<tr><td>5. 설치, 교육 및 사후관리</td><td></td></tr>
<tr><td>6. 품질보증 기간 (Warranty)</td><td>제품 납품 후 1년</td></tr>
<tr><td>7. 납기일자</td><td>발주 후 5주 이내</td></tr>
<tr><td>8. 계약업체 제출서류</td><td></td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| **9. 참가자격** | |
| **10. 참가자격 제출서류** | |
| **11. 기타사항** | 화학나노과학과 / 박재홍 교수님 /<br>담당자: 조가영 02-3277-3950 |